



# SPC 150

## SOFT PLASMA CLEANER

### 高真空等离子体清洗仪

The SPC150 is a high-vacuum, gentle plasma cleaner equipped with three gas path MFCs for precise gas flow control. The remote RF ion source ionizes the gas to produce a mild plasma, enabling the removal of organic and silicon contaminants from TEM samples and sample rods, as well as surface activation and hydrophilization. A grid is placed between the ion source and the sample chamber to achieve a more efficient and gentle cleaning effect, avoiding plasma bombardment damage. This makes it particularly suitable for cleaning hydrocarbon and silicon contamination on ultrathin carbon films and for plasma treatment of fragile and sensitive TEM samples.

SPC150是一款高真空轻柔等离子体清洗仪，三个气路MFC可精确控制气体流量，远程射频离子源电离气体产生温和的等离子体，实现TEM样品和样品杆表面有机污染物和硅污染清除、样品表面活化亲水化处理等用途。离子源和样品仓之间设有栅网，可以产生更高效柔和的清洗效果，避免等离子体轰击损伤，特别适用于超薄碳膜碳氢污染和硅污染清洗、脆弱敏感的TEM样品等离子体处理等用途。

触摸屏控制，一体化设备，即插即用。



超薄碳膜无损清洗

RF-ICP技术

温和等离子体清洗

无油更清洁

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan,

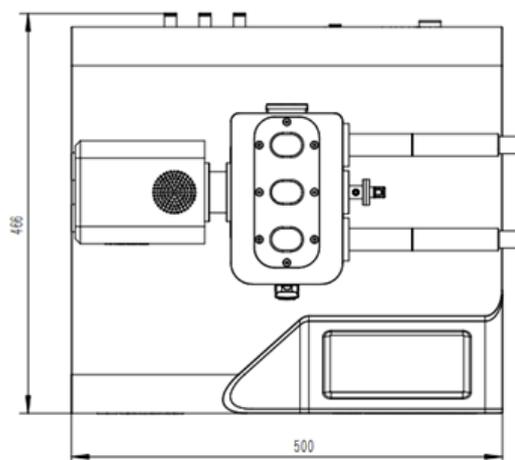
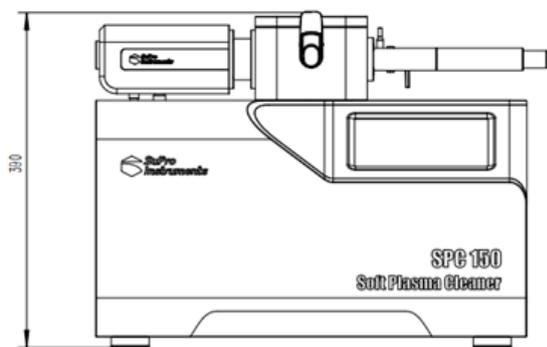
Shenzhen, China

[www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
泵组	涡轮分子泵+无油隔膜泵
分子泵入口法兰	DN63ISO-K (标准)
分子泵抽速	>85L/s (N <sub>2</sub> )
前级泵	>0.7m <sup>3</sup> /h
极限真空	<5E-4Pa
泵组启动时间	≤ 300s
TEM样品杆配件	适配Thermo、JEOL、Hitachi样品杆可选; 可放置2路以上TEM holder
样品腔室尺寸	~160 *100 mm, 等离子体处理强弱分区设置
等离子体清洗源	远程RF射频源原理, 手动匹配
清洗电源功率	13.56MHz RF电源, 5-50W可调
清洗气体控制	标配3路MFC流量计控制, 可以外接如Ar、O <sub>2</sub> 和H <sub>2</sub> 等气体
真空规	进口品牌全量程复合规
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
重量	~30Kg
尺寸	500mm宽*466mm深*390mm高
电源	100-220VAC, 50/60Hz接地三脚插头
功耗	<500W
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

www.suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司 (北京办)

地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室

邮件: zkchang@suproinst.com

速普仪器 (太仓) 有限公司

地址: 江苏省苏州市太仓市大学科技园11号楼1003室